

Notice of Ground of Rejection

Patent Application No.: 2002-274489

Proposed Date: Feb. 10, 2004

Examiner of Japanese Patent Office: K.KATO 8617 4E00

Patent Attorney: Y.KAJI (and one other)

Applied Clause: Paragraph 2, Article 29

The present application shall be rejected on the following ground. If there is any argument, please submit an Argument within 60 days from the mailing date of this Notice.

Ground

The present application cannot be patentable under Paragraph 2, Article 29 of the Patent Law because the inventions related to the following claims of the present application can be easily made by a person skilled in the art from the cited documents set forth below, on the ground of inventions described in the following publication distributed in Japan or foreign countries or inventions which became available to the public through a telecommunication line before the application.

Below (Refer to list of cited documents for cited documents.)

- Claims 1 to 8
- Cited documents 1 to 5
- Remark

Generally, isolating a place with a possibility of pollutant to be

formed from other sections to provide an exhaust mechanism in each section is a well-known structure (for example, Claim 1, [0015] to [0017] of the cited example 2, and Fig. 1 of the cited example 3).

Accordingly, in an apparatus described in the cited example 1, dividing an electrolysis tank provided in a cabinet and a tower attached for the purpose of removing HF by a section can be properly made by a person skilled in the art.

In [0021] of the cited example 1, there is described "H₂ gas 6 is introduced to a removing apparatus which is not shown", and providing second absorption means absorbing a hydrogen fluoride among hydrogen gas and a partition wall dividing the second absorption means can be easily made by a person skilled in the art.

For retention means and pressure means, refer to the descriptions of Claim 6, [0023], etc. of the cited example 1.

For a hot water heating apparatus, refer to the descriptions of [0058], Fig. 4, etc. of the cited example 4.

Preparing a plurality of removing tubes to replace when substituting is a commonly used means (for example, line 18 of page 9 and line 1 of page 10 of the cited example 5), and providing a member which is an object of substitution is merely a design item.

List of cited documents

1. Japanese Unexamined Patent Application Publication No. 2001-295086
2. Japanese Unexamined Patent Application Publication No. Hei10-199814
3. Japanese Unexamined Patent Application Publication No. Sho64-015373
4. Japanese Unexamined Patent Application Publication No. Hei05-005194
5. A microfilm of Japanese Utility Model Application No. Sho59-201934
(Unexamined Utility Model Publication No. Sho61-114199)

Record of prior art documents search result

Search field the 7th edition of IPC C25B1/24

The record of prior art documents search result may not constitute a ground for rejection.

If there is any inquiry or if you need an interview about the Notice of Submission of Argument, please call the number below.

Patent Examination Division 3

Metalworking K.KATO

TEL. 03(3581)1101, extension 3425

FAX. 03(3580-6905)

拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願2002-274489
起案日	平成16年 2月10日
特許庁審査官	加藤 浩一 8617 4E00
特許出願人代理人	梶 良之 (外 1名) 様
適用条文	第29条第2項

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

理由

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

- ・請求項 1 - 8
- ・引用文献等 1 - 5

・備考

一般に汚染物質が生じる可能性がある場所を他の区画と隔離し、各区画に排気機構を設けることは周知の構造（例えば、引例2の請求項1、【0015】-【0017】、引例3の第1図）である。

従って、引例1に記載された装置において、キャビネット内に設けられた電解槽とHF除去目的で付設された塔とを区画に仕切ることは当業者が適宜なし得たことである。

引例1の【0021】に「H₂ガス6は図示しない除外装置へ導入される。」とあり、引例1の装置に水素ガスの中のフッ化水素を吸着する第2吸着手段及び該第2吸着手段を区画する隔壁を設けることは当業者が容易になし得たことである。

貯留手段、加圧手段については、引例1の請求項6、【0023】等の記載を参照されたい。

温水加熱装置については、引例4の【0058】、図4等の記載を参照された

い。

除去筒を複数用意し、交換時などに切り替えて使用することは慣用（例えば、引例5の第9頁18行、第10頁第1行）手段であり、交換の対象となる部材を運搬物体上に設置することは単なる設計事項にすぎない。

引用文献等一覧

1. 特開2001-295086号公報
2. 特開平10-199814号公報
3. 特開昭64-015373号公報
4. 特開平05-005194号公報
5. 実願昭59-201934号（実開昭61-114199号）のマイクロフィルム

先行技術文献調査結果の記録

・調査した分野 I P C 第7版 C 2 5 B 1 / 2 4

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

この拒絶理由通知の内容に関するお問い合わせ、または面接のご希望がございましたら下記までご連絡下さい。

特許審査第三部金属加工 加藤 浩一
TEL. 03(3581)1101 内線3425
FAX. 03(3580-6905)